

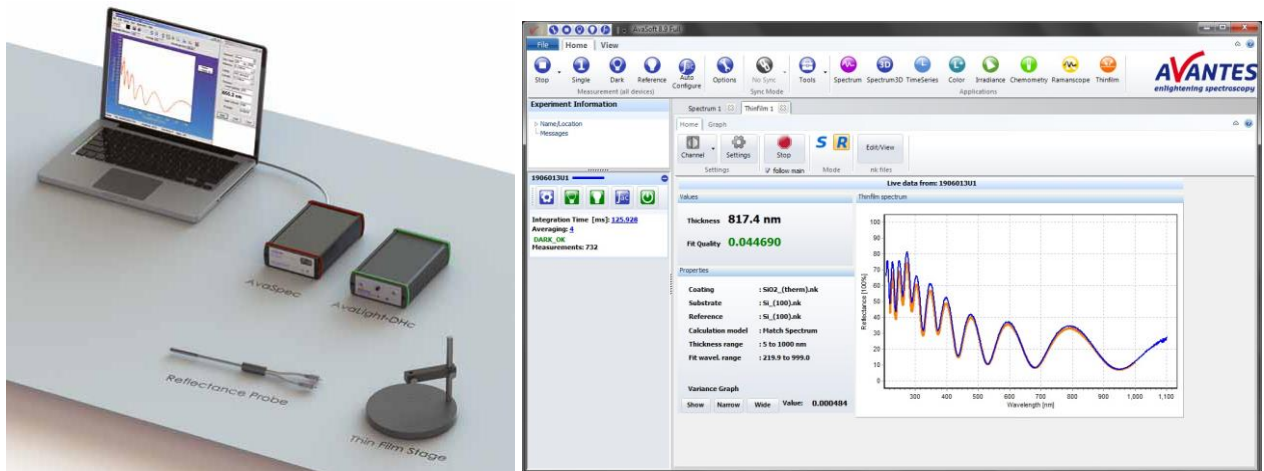
# 光学干渉式リアルタイム膜厚モニター

## 膜厚測定

本膜厚モニターを用いることにより様々な薄膜の厚みを非接触でしかもリアルタイムに測定を行うことが可能です。1nm の分解能で10nm～50  $\mu$ m までの膜厚を測定できます。

測定サンプルより反射される白色光の干渉パターンを観測し、薄膜材料の物性値を用いることにより光学膜厚へと変換されます。単層膜の場合、材料の n 値(屈折率)及び k 値(消衰係数)が予め分かっている場合は、膜厚を算出することが可能です。

専用ソフトウェア: AvaSoft-Thinfilm は、一般的によく使用されるマテリアルやコーティング材料(レジスト、酸化物、窒化物、ポリイミド、セルギャップなど)の n 値(屈折率)と k 値(消衰係数)がデータベース化されており、測定対象物に応じて選択することが可能です。



分光器	<b>AvaSpec-ULS2048CL-EVO</b>
	Grating UA(200 ~ 1100nm), DCL-UV/VIS, 100 $\mu$ m slit, OSC-UA
膜厚 / 分解能	10nm ~ 50 $\mu$ m , 分解能 : 1nm
ソフトウェア	AvaSoft-Thinfilm
光源	AvaLight-DHc (重水素-ハロゲンランプ)
ファイバー	反射プローブ: FCR-7UVIR400-2-ME, 2m, SMA